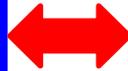


複合式鍍膜設備與製程技術開發



本中心設計製造的HiPIMS + Arc複合式鍍膜設備(NT\$1800萬元)



2015年發表，全世界第一台



High Ionization 3 (triple)
The **Combination** of three high ionization processes has been developed.

Oerlikon Metaplas has developed and combined 3 technologies with high ionization:

- AEGD: high ionized plasma etching process
- APA Arc: high ionized arc coating process
- HIPIMS: high ionized sputter coating process



全世界最新穎的HiPIMS + Arc複合式鍍膜設備 (NT\$3500萬元)

- ✓ 合作企業:
*亮傑科技有限公司
- ✓ 產學計畫3件，
金額共計
2,828,000元

本整合型計畫由張奇龍教授設計，亮傑科技公司製造完成的高功率脈衝磁控濺鍍(HiPIMS)+矩形靶陰極電弧(Arc)複合式鍍膜系統，其鍍膜設備功能已經達到德國Oerlikon Balzers公司的技術水準，因此本整合計畫致力推廣這套最新穎的複合式鍍膜系統與鍍膜技術的Turnkey solution到台灣與亞洲地區，以大幅提升我國鍍膜產業的設備與製程技術能力。